

nanomicro biz **ROBOTECH**

終了報告書

2015年4月22日(水) - 24日(金)

パシフィコ横浜

ホール B / アネックスホール

開催概要

- 名称 : ナノ・マイクロ ビジネス展
ROBOTECH 次世代ロボット製造技術展
- 会期 : 2015年4月22日(水) - 4月24日(金) 10:00-17:00
- 会場 : パシフィコ横浜 ホールB/アネックスホール
〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 1-1-1
- 主催 : 一般財団法人マイクロマシンセンター
<http://www.mmc.or.jp/>
- オーガナイザー : メサゴ・メッセフランクフルト(株)
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 1-3-2 曙杉館 7F
Tel. 03-3262-8446 Fax. 03-3262-8442
E-mail. info@micromachine.jp
Web. www.micromachine.jp
- 後援 : 経済産業省/国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)/
(独)日本貿易振興機構(JETRO)
- 協賛 : (一社)日本機械工業連合会 / (一社)日本ロボット工業会 / (一社)日本分析機器
工業会 / (一社)日本ロボット学会 / ロボットビジネス推進協議会 /
東京大学 IRT 研究機構 / 日本真空工業会 /
(一社)ナノテクノロジービジネス推進協議会
- 入場料 : ¥2,000(税込)
※ただし、招待状持参者およびWEBからの来場事前登録者は無料
- 同時開催展 : OPIE'15 (OPTICS & PHOTONICS International Exhibition)
- 併催セミナー : 第21回 国際マイクロマシン・ナノテクシンポジウム
トリリオンセンサーの応用例と今後の進展(パネルディスカッション)
TIA N-MEMS シンポジウム/MEMS 協議会フォーラム
社会課題対応システム関連プロジェクト成果報告会
フィンランドVTTセミナー
MEMS 協議会産学連携ワークショップ
出展者プレゼンテーション
オープンイノベーションプレゼンテーション

出展者数

■ 国別出展者数

出展者数：110社(150小間)／7カ国・地域(国内:101社(147小間) 海外:9社(3小間))

※数字は共同出展者を含みます。

1	日本	101	5	リトアニア	1		
2	ドイツ	2	6	イギリス	1		
3	カナダ	2	7	スウェーデン	1		
4	フィンランド	2					
Total					110	2014年実績	186
内訳	国内				101	国内	145
	海外				9	海外	17

来場者数

■ 日別来場者数

15,714名／37カ国・地域(※)

2015年	4/22日(水)	23日(木)	24日(金)	合計
OPIE'15/ナノ・マイクロ ビジネス展 / ROBOTECH 来場登録者数	5,310	5,049	5,355	15,714
2014年	4/23日(水)	24日(木)	25日(金)	合計
OPIE'14/ナノ・マイクロ ビジネス展 / ROBOTECH 来場登録者数	5,856	5,894	6,487	18,237

※ナノ・マイクロビジネス展 / ROBOTECH と同時開催された OPIE は、来場者の相互入場を可能としているため、上記来場者数は2展示会の合算の来場者数にて発表しております。

■ 国別来場者数 15,714名／37カ国・地域

1	日本	15,138	14	タイ	6	27	イタリア	2
2	韓国	130	15	オランダ	5	28	ロシア	2
3	中国	95	16	ポーランド	5	29	オーストリア	1
4	台湾	92	17	ベナン	5	30	バングラデッシュ	1
5	アメリカ合衆国	86	18	シンガポール	5	31	ガンビア	1
6	ドイツ	31	19	デンマーク	4	32	ガーナ	1
7	フランス	21	20	スウェーデン	4	33	アイルランド	1
8	イギリス	13	21	フィンランド	4	34	マレーシア	1
9	香港	9	22	イスラエル	4	35	ノルウェー	1
10	インド	8	23	ブラジル	4	36	ペルー	1
11	スイス	8	24	カナダ	4	37	セネガル	1
12	スペイン	8	25	リトアニア	3	合計		15,714名
13	オーストラリア	7	26	チェコ	2			

■ 業種別来場者割合

業種	%
<メーカー>半導体・電子部品・MEMS デバイス	17.6 %
<メーカー>微細加工装置・MEMS 製造装置・検査装置	3.6 %
<メーカー>その他の製造装置・検査装置	6.2 %
<メーカー>電気・電子機器・総合電機	13.1 %
<メーカー>精密機器	8.3 %
<メーカー>バイオ・医療機器・介護機器	1.7 %
<メーカー>産業用ロボット	1.3 %
<メーカー>サービスロボット	0.3 %
<メーカー>ゲーム・アミューズメント機器	0.2 %
<メーカー>自動車関連	3.5 %
<メーカー>航空宇宙・船舶・その他の輸送機器	0.6 %
<メーカー>化学品	3.0 %
<メーカー>医薬品	0.2 %
<メーカー>化粧品	0.1 %
<メーカー>有機・無機材料	2.2 %
<メーカー>その他	5.7 %
メーカー合計	67.6 %
情報・通信・ソフトウェア	5.4 %
電力・ガス・エネルギー	0.7 %
建設・建築	2.7 %
商社・代理店・システムインテグレーター	9.0 %
官公庁・協会・団体・研究機関	3.6 %
学校・教育機関	3.6 %
学生	1.0 %
その他	6.2 %
無回答	0.2 %
合計	100.0 %

■各種セミナープログラム

アネックスホール(F203)セミナー／Annex hall (F203) seminar

事前予約優先(後日にも参加可能) 聴講無料/Free of Charge

4月22日(水)

同時通訳(日・英)

VTTフィンランドセミナー

VTT Technical Research Centre of Finland Ltd. (VTTフィンランド技術研究センター)は、北欧エリアで主要な技術開発研究所です。最先端で特許ある研究成果と豊富な知識をコアに、技術ソリューションサービスを提供しています。VTT MEMS研究部は、1990年代初期からMEMS技術を開発し、後のMEMS技術へと発展してまいりました。この技術は、MEMSデバイスによる今日のVTT センシングソリューションを支えています。今日のVTTセミナーは、日本のビジネス交流をより深めるために、フィンランド現地でVTTパートナーおよびVTTからスウェーデンのベンチャーや日本と関連のあるフィンランド企業から、様々な技術や商品などを紹介いたします。



- 10:30 ▶ 10:40 開会挨拶 (一財)マイクロマシンセンター 専務理事 青柳 桂一/Aarne Oja, VTT
10:40 ▶ 10:55 トリオンセンサ社会に向けたマイクロマシンセンターの最近の取組み (一財)マイクロマシンセンター 今本 浩史
10:55 ▶ 11:10 VTTのMEMS/ハイライト Aarne Oja, VTT
11:10 ▶ 11:30 ロームのセンサ技術 ~MEMS, PZT, 磁気, 光センサ~ ローム(株)センサ事業推進 大西 大
11:30 ▶ 11:45 顕微鏡カメラを使った非破壊検査と品質保証の材料解析 Juha Kallioopuska, Advacam
11:45 ▶ 12:00 Picosunの最新ALDによる改良型バリア層のご紹介 Picosun 佐藤 博
12:00 ▶ 12:15 消費者向けMEMSセンサーの最終検査にウェアレハブルテストハンドラーを使用したことでの費用便益について Vesa Henttonen, Alore
12:15 ▶ 12:30 フィンランドとのビジネスチャンスについて Toni Mattila, Invest in Finland

第21回 国際マイクロマシン・ナノテクシンポジウム 「更なる成長へ、スマートモニタリングの進展を飛躍的に強化する新技術」

主催 (一財)マイクロマシンセンター
スマートフォンのウェアラブルシステム、更に医療センサと高い成長が期待されるスマートモニタリングを実現するMEMSですが、この成長を支える新技術が世界中で導入されています。今回は更なる成長を約束するスマートモニタリングデバイスを、飛躍的に高機能化する新技術に焦点を絞って、国内の最新動向、欧州と米国の最新動向の話題を取り上げ、将来のMEMS産業の新たな可能性を探って参ります。

- オープニング
13:00 ▶ 13:05 開会挨拶 (一財)マイクロマシンセンター 理事長 山西 健一郎
セッション1 更なる成長へ、スマートモニタリングデバイスを飛躍的に高機能にする新技術
特別講演 Chip Scale Atomic Clocks for Distributed Sensor Networks
13:05 ▶ 13:55 Leader, Atomic Devices and Instrumentation Group, Time and Frequency Division, Fellow, National Institute of Standards and Technology/USA Dr. John Kitching
13:55 ▶ 14:25 完全自動運転に向けた最先端モニタリング技術
14:25 ▶ 14:55 無電源・永く動作を保證する帯電型エネルギーハーベスタの最新動向
14:55 ▶ 15:05 休憩
セッション2 更なる成長へ、世界の最先端研究所・工業界からの報告
15:05 ▶ 15:35 トリオンセンサの最新動向
15:35 ▶ 16:05 Advancing MEMS R&D in materials, processes and devices to face major needs arising from the booming MEMS market
16:05 ▶ 16:25 MEMS devices enabled by material innovation
クロージング
16:25 ▶ 16:30 来賓挨拶
16:30 ▶ 16:35 閉会挨拶 (一財)マイクロマシンセンター 専務理事 青柳 桂一

4月23日(木)

トリオンセンサの応用例と今後の進展

ヒトや環境物などあらゆるものをセンシングし、そのデータを活用することで、革新的な社会・生活が実現できるという期待が高まっています。また、AI/ビッグデータソリューションでは、センシング技術を基盤とした「アプリケーション」の先進者・急成長していることが、今後の可能性と更なる飛躍に向けた課題の解決方法を議論します。

- 10:30 ▶ 11:15 パネリスト: (株)TES 代表取締役 菅沼 久忠、(株)エムティーアイヘルスケア事業部 事業部長 秋田 正俊、アンリデータター: (株)日経BIP 白根レオロニクス 副社長 三宅 清之

社会課題対応システム関連プロジェクト成果報告会

- オープニング
12:00 ▶ 12:10 開会挨拶 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)
セッション1 グリーンセンサ・ネットワークシステム技術開発プロジェクト成果報告会
12:10 ▶ 12:40 グリーンセンサスマート社会を
セッション2 第1回 ライフラインコアモニタリングプロジェクト成果報告会
12:40 ▶ 13:10 UCoMSプロジェクトのミッションとIoTへのインパクト
13:10 ▶ 13:25 圧電MEMS駆動発電センサデバイスの開発
13:25 ▶ 13:40 環境センサ・発電用MEMSプロセスプラットフォーム技術の開発
13:40 ▶ 13:55 ネットワーク気象計と小型無線センサへの取組み
13:55 ▶ 14:10 920MHz無線マルチホップネットワークの低消費電力化技術の開発
14:10 ▶ 14:25 回転磁界の駆動特性とモニタリングシステムの開発
セッション3 第1回 道路インフラモニタリングプロジェクト成果報告会
14:25 ▶ 15:05 特別講演1
15:05 ▶ 15:45 特別講演2
15:45 ▶ 16:25 クロージング
16:25 ▶ 16:30 閉会挨拶

22 April (Wed)

Simultaneous Interpretation (English / Japanese)

VTT Seminar

- 10:30 ▶ 10:40 Opening Remarks
10:40 ▶ 10:55 Recent Activity of Micromachine Center for Trillion Sensors World
10:55 ▶ 11:10 VTT high lights in MEMS
11:10 ▶ 11:30 ROHM sensor technology, - MEMS, PZT, magnetic, and optical sensors -
11:30 ▶ 11:45 Cameras for material resolving transillumination for non-destructive testing and quality assurance
11:45 ▶ 12:00 Improved barrier layers with novel Picosun ALD solutions
12:00 ▶ 12:15 Cost benefits of using Wafer Level Test Handler in Final Test of Consumer MEMS sensors
12:15 ▶ 12:30 Finland as a Business Opportunity

The 21st International Micromachine Nanotech Symposium Advanced MEMS & Sensor Technologies for Future Industry Growth

Presented by Micromachine Center
Chair: Prof. Isao Shimoyama, University of Tokyo, International Exchange Committee Chair-MEMS Industry Forum

- オープニング
13:00 ▶ 13:05 Opening Remarks
セッション1 New Technologies for Smart Monitoring
13:05 ▶ 13:55 Chip Scale Atomic Clocks for Distributed Sensor Networks
13:55 ▶ 14:25 Advanced Autonomous Vehicle Monitoring Technology
14:25 ▶ 14:55 High Efficiency Micro Energy Harvesters for Trillion Sensor World
セッション2 MEMS Collaboration Session
15:05 ▶ 15:35 Trillion Sensors Update
15:35 ▶ 16:05 Advancing MEMS R&D in materials, processes and devices to face major needs arising from the booming MEMS market
16:05 ▶ 16:25 MEMS devices enabled by material innovation
クロージング
16:25 ▶ 16:30 Guest Speech
16:30 ▶ 16:35 Closing Remarks

4月24日(金)

TIA N-MEMSシンポジウム/MEMS協議会フォーラム 新産業革命を支えるMEMS

主催 (一財)マイクロマシンセンター
後援 株式会社イノベーションリーナノテクノロジー拠点運営最高会議
センサと情報通信技術が高度に融合した新産業革命の「インダストリー4.0」という概念が、ドイツを中心に活発化しています。その最前線を駆け上り、またTIAの新しい挑戦を語りながら、これらの新しい波に乗るMEMS協議会の諸活動を紹介します。参加者へのPR、意見交換の場を提供します。

- オープニング
13:30 ▶ 13:35 開会挨拶 MEMS協議会 副会長 前田 龍太郎
セッション1 特別講演 新産業革命に向けた新しい動向
13:35 ▶ 14:20 特別講演1
14:20 ▶ 14:50 特別講演2
セッション2 MEMS協議会活動とMEMS産業動向・技術動向
14:50 ▶ 15:10 工程受託サービスを開始したMNOIC、およびMEMS協議会活動
15:10 ▶ 15:30 中国・韓国の存在感が増しつつある国際標準化活動、規格獲得競争から活用重視へ
15:30 ▶ 15:50 MEMS技術動向:世界のMEMS関連学会の発表からビジネス注目分野を展望
15:50 ▶ 16:10 新製造革命を支えるセンサ産業と、それを支える最新技術動向
クロージング
16:10 ▶ 16:15 閉会挨拶

※敬称略。講演者および講演内容は都合により変更する場合がございます。(2015年4月9日現在) Subject to change, as at April 9, 2015

展示ホール内プレゼンテーションルーム/Presentation room

定員80名 事前予約不要 聴講無料

オープンイノベーションプレゼンテーション/Open innovation presentation

4月22日(水)

- 10:30 ▶ 10:45 LiNbO3を利用した車載用小型加速度センサーの開発事例 (地独)青森県産業技術センター
- 10:45 ▶ 11:00 工程受託サービスを開始したMNOIC (一財)マイクロマシンセンター MNOIC
- 11:00 ▶ 11:15 最先端材料開発のサポート～電子顕微鏡を中心とした解析事例紹介～ (公財)神奈川科学技術アカデミー(KAST)
- 11:15 ▶ 11:30 京都大学ナノテクノロジーハブ拠点概要とご利用方法 京都大学 ナノテクノロジーハブ拠点
- 11:30 ▶ 11:45 先端光加工プロジェクトの紹介 先端光加工プロジェクト(京都産学共同研究拠点「知恵の輪」)
- 11:45 ▶ 12:00 ナノテクノロジープラットフォームが拓くデバイスイノベーション 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム
- 12:00 ▶ 12:15 福島県ハイテクプラザの微細加工技術～微細金型作製技術と射出成型技術～ 福島県ハイテクプラザ
- 12:15 ▶ 12:30 山形県のMEMS技術について 山形県工業技術センター
- 12:30 ▶ 12:45 産総研共用施設のご紹介 国立研究開発法人産業技術総合研究所 つくばイノベーションアリーナ推進センター

4月23日(木)


- 10:30 ▶ 10:45 京都大学ナノテクノロジーハブ拠点概要とご利用方法 京都大学 ナノテクノロジーハブ拠点
- 10:45 ▶ 11:00 マイクロ流体デバイスの開発と機器開放利用 4大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアム
- 11:00 ▶ 11:15 ナノテクノロジープラットフォームの活用方法 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム
- 11:15 ▶ 11:30 先端光加工プロジェクトの紹介 先端光加工プロジェクト(京都産学共同研究拠点「知恵の輪」)
- 11:30 ▶ 11:45 山形県のMEMS技術について 山形県工業技術センター
- 11:45 ▶ 12:00 最先端材料開発のサポート～電子顕微鏡を中心とした解析事例紹介～ (公財)神奈川科学技術アカデミー(KAST)

4月24日(金)

- 10:30 ▶ 10:45 山形県のMEMS技術について 山形県工業技術センター
- 10:45 ▶ 11:00 福島県ハイテクプラザの微細加工技術～微細金型作製技術と射出成型技術～ 福島県ハイテクプラザ
- 11:00 ▶ 11:15 ナノテクノロジープラットフォームが拓くデバイスイノベーション 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム
- 11:15 ▶ 11:30 先端光加工プロジェクトの紹介 先端光加工プロジェクト(京都産学共同研究拠点「知恵の輪」)
- 11:30 ▶ 11:45 京都大学ナノテクノロジーハブ拠点概要とご利用方法 京都大学 ナノテクノロジーハブ拠点
- 11:45 ▶ 12:00 最先端材料開発のサポート～電子顕微鏡を中心とした解析事例紹介～ (公財)神奈川科学技術アカデミー(KAST)
- 12:15 ▶ 12:30 LiNbO3を利用した車載用小型加速度センサーの開発事例 (地独)青森県産業技術センター
- 12:30 ▶ 12:45 産総研共用施設のご紹介 産業技術総合研究所 つくばイノベーションアリーナ推進センター

出展者プレゼンテーション/MEMS協議会産学連携ワークショップ Exhibitor presentation / Mems industry workshop

4月22日(水)

- 13:30 ▶ 13:50 光ファイバー角速度センサ(FOG)を超えるMEMS-GYRO (株)シリコンセンシングシステムズジャパン [C6]
 


MEMS-Gyroセンサの老舗であるシリコンセンシングが、MEMS技術を極めることで、到達したFOGセンサを超えるMEMS-Gyroへの道のりをご紹介します。また、この最新MEMS-Gyroを用いた航空宇宙分野、無人機制御、ロボット工学等に選んだ6軸慣性装置の紹介をいたします。
- 14:00 ▶ 14:20 微細加工と表面機能 首都大学東京 結實研究室 [A15]

固体表面にマイクロ/ナノメートルレベルの微細構造を設けることにより、濡れ性、光学機能、腐蝕特性あるいは生体適合性といった様々な表面機能を達成することが可能です。これらを調整する際の設計の考え方や応用を紹介するとともに、炭素ナノチューブを利用したプロセスの適用可能性についても紹介します。
- 14:30 ▶ 15:20 ロボットがビジネスとして立ち上がり普及していくために かわさき・神奈川ロボットビジネス協議会 [B7]


神奈川県内で実施した実証実験の運営手法、安全性の確保など、ロボットが商品化されるまでにクリアしておかなければならないポイントについて解説します。
- 16:00 ▶ 16:20 磁歪材料を用いた振動発電技術の実用化展開 金沢大学振動発電研究室 [A11]

磁歪材料を用いた振動発電技術の実用化展開について、橋梁や自動車の振動を利用し電池不要で動作するワイヤレスセンサシステムを例に、発電デバイスの振動への対応(帯共振周波数・高出力化)、その開発の現状と将来性を紹介します。

4月23日(木)

- 13:30 ▶ 14:20 トリリオンセンサ社会に向けたSPTの加工装置群(ミニマル装置～300mm装置) SPPテクノロジー(株) [C8]
 

MEMS製品に不可欠なS深掘り装置(DRIE)のトップメーカーとして、米国SPTS社と共に蓄積した豊富な経験に基づく幅広いソリューションを具体化したプロセス装置を開発したミニマル装置(DRIE、TEOS-CVD、メタルエッチング)をご紹介します。トリリオンセンサ社会に向けた加工装置をご紹介します。
- 14:30 ▶ 15:20 MEMSデバイスを使った高周波キャピティフィルタの解析事例 計測エンジニアリングシステム(株) [B5]

MEMSデバイスを使った高周波キャピティフィルタの解析事例をご紹介します。
- 15:30 ▶ 15:50 PZTジャイロ事業化例とMEMSファンドリの紹介 (株)シリコンセンシングシステムズジャパン [C6]
 

近年、垂直統合型のモノ作りから生産部門を外部に委託するビジネスモデルへと見直されています。シリコンセンシングは15年連続売上MEMS増産技術と統合システムファクトリーサービスで貢献しています。開発事例としてPZTジャイロの紹介、及びファンドリを用いている事業化モデルとそのメリットについて説明します。

4月24日(金)

- 13:30 ▶ 13:50 MEMSパッケージシリーズテストの最新技術と動向 (株)フクダ [B4]
 

MEMSパッケージの封印形状を非破壊検査にて高精度・高速で測るシリーズテストシステムをご紹介します。弊社技術部より、ヘリウムリーク検出4E-10Pa以内の高感度リーク試験技術の概要を説明いたします。
- 14:00 ▶ 14:20 シリコン深掘り技術の最新動向 サムコ(株) [C2]
 

シリコン深掘り技術の一つにボッシュプロセスがあります。2003年にサムコは日本の半導体製造装置メーカー初のライオンとなり、装置を開発し提供してきました。近年ではMEMSデバイスにおいて欠かせない技術です。今回、最新のボッシュプロセス技術と共に、サムコの最新開発DRIE-000PBCをご紹介します。
- 14:30 ▶ 14:50 人と協働作業する次世代ロボットへの使命(Change the World) カンタムエレクトロニクス(株) [B9]
 

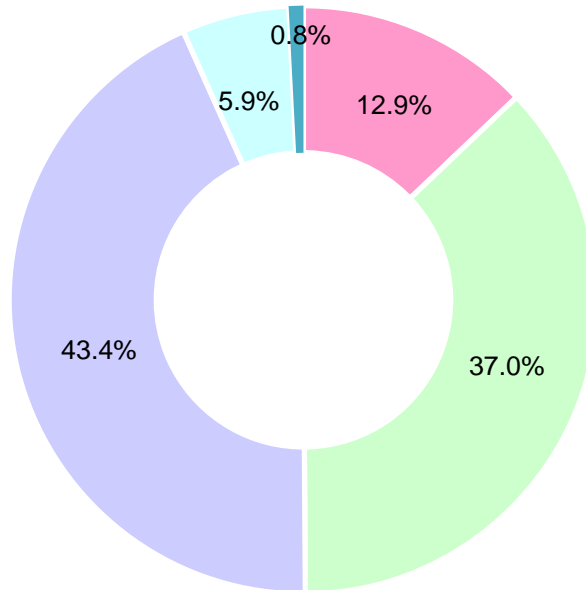
人と協働作業できるロボットは、今もっとも注目されているロボットです。少子化、産業の空洞化防止、作業現場の自動化の為にロボットが必要とされていますが、今回はもっとも未来を見据え、真の意味での「人、協働ロボット」について、海外事例を含めお話ししたいと思います。
- 16:00 ▶ 16:20 MEMS技術による各種超小型センサとその応用 九州大学 ナノ・マイクロ工医学研究室 [A21]

MEMS技術を用いて開発した高精度で超小型の集積型レーザドップラ血液計、マイクロレーザードップラ速度計、マイクロエンコーダ、セン断力センサ、及びモニタリングに集積したPDとVCSELから構成される超小型位置センサなど出品しているMEMSデバイスの概略とその応用例について講演します。

来場者アンケート結果

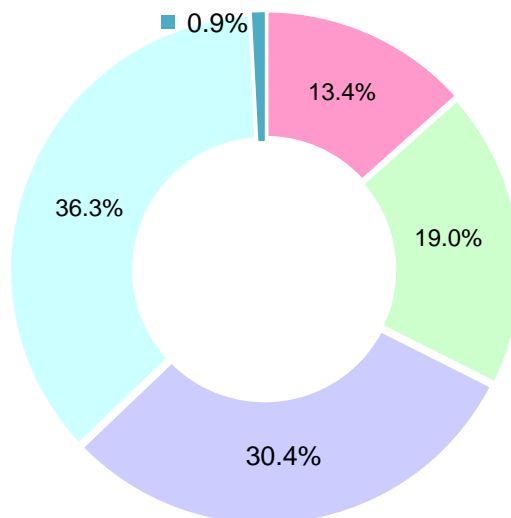
1. あなたの役職は？

1	経営者・役員・オーナー	12.9%
2	管理職	37.0%
3	社員・職員	43.4%
4	その他	5.9%
5	不明・無回答	0.8%

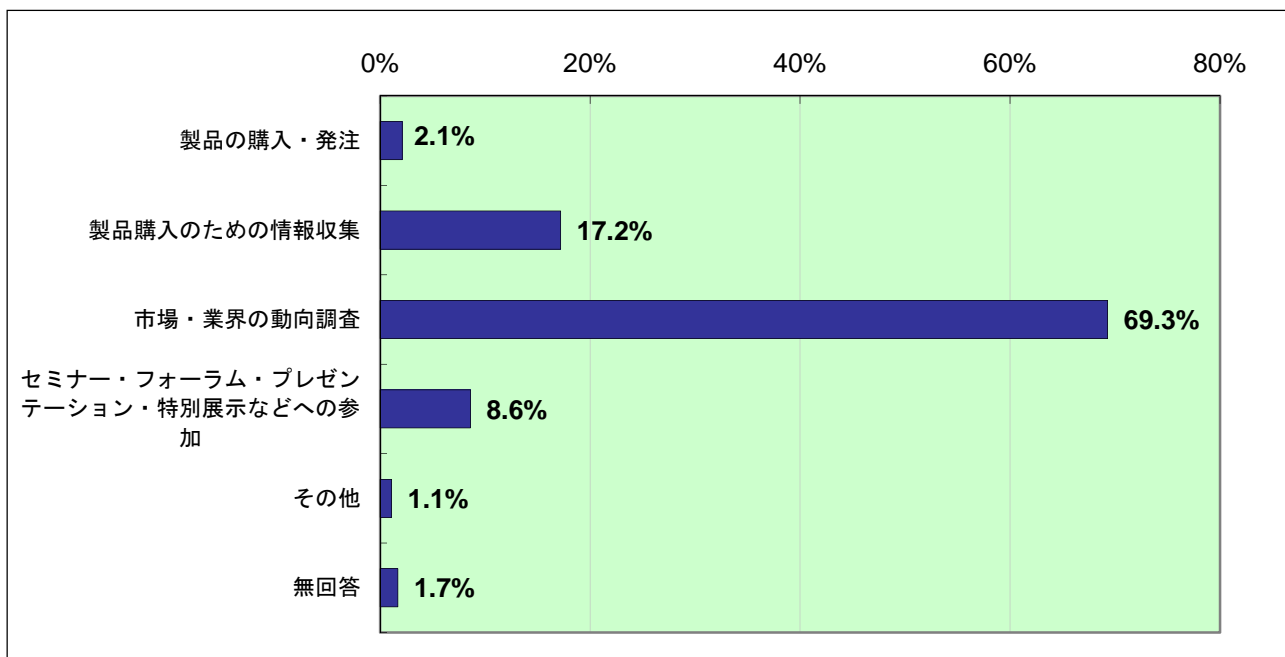


2. 商品の買付決定権を持っていますか？

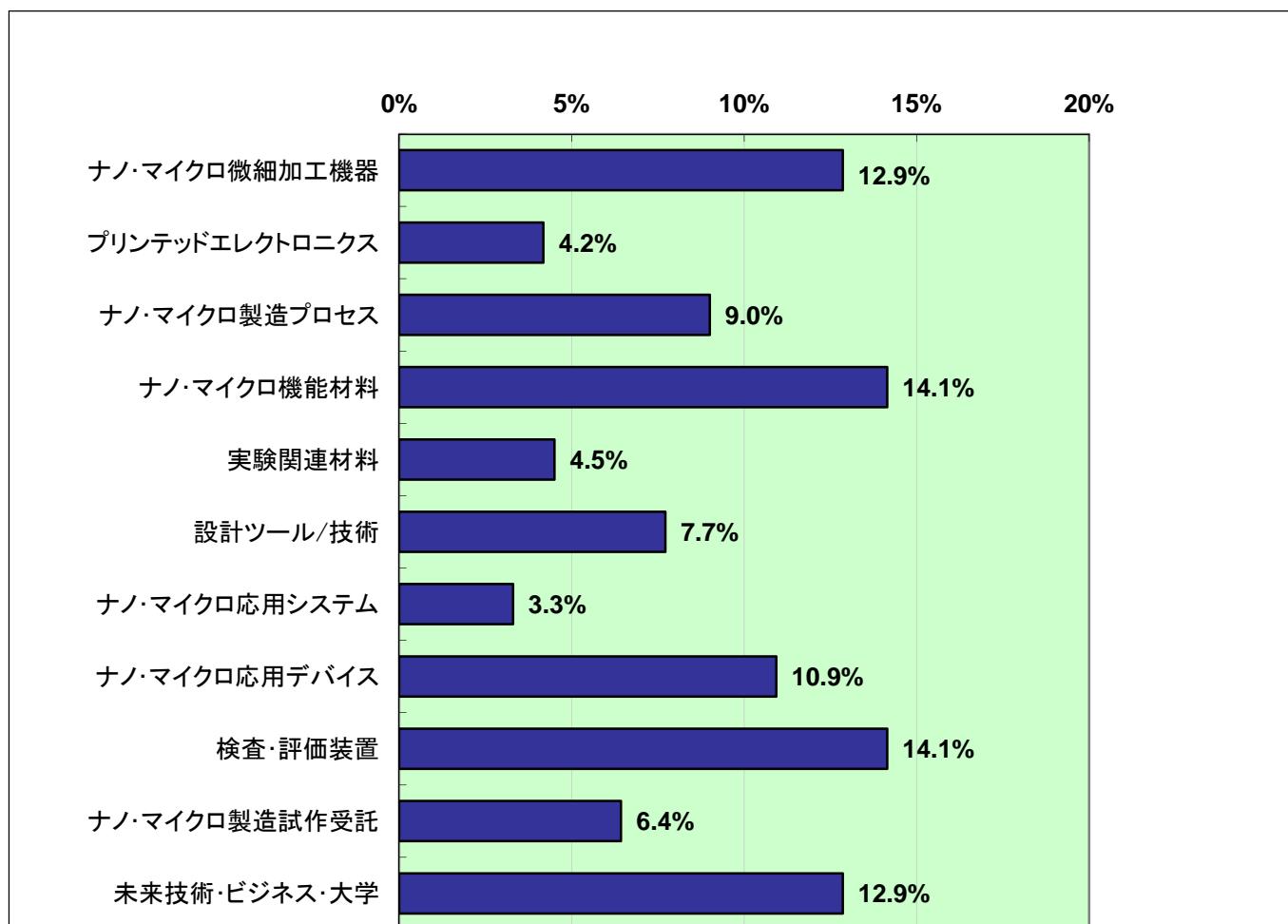
1	決定権を持っている	13.4%
2	一部決定権を持っている	19.0%
3	決定に影響力を持っている	30.4%
4	決定権を持っていない	36.3%
5	不明・無回答	0.9%



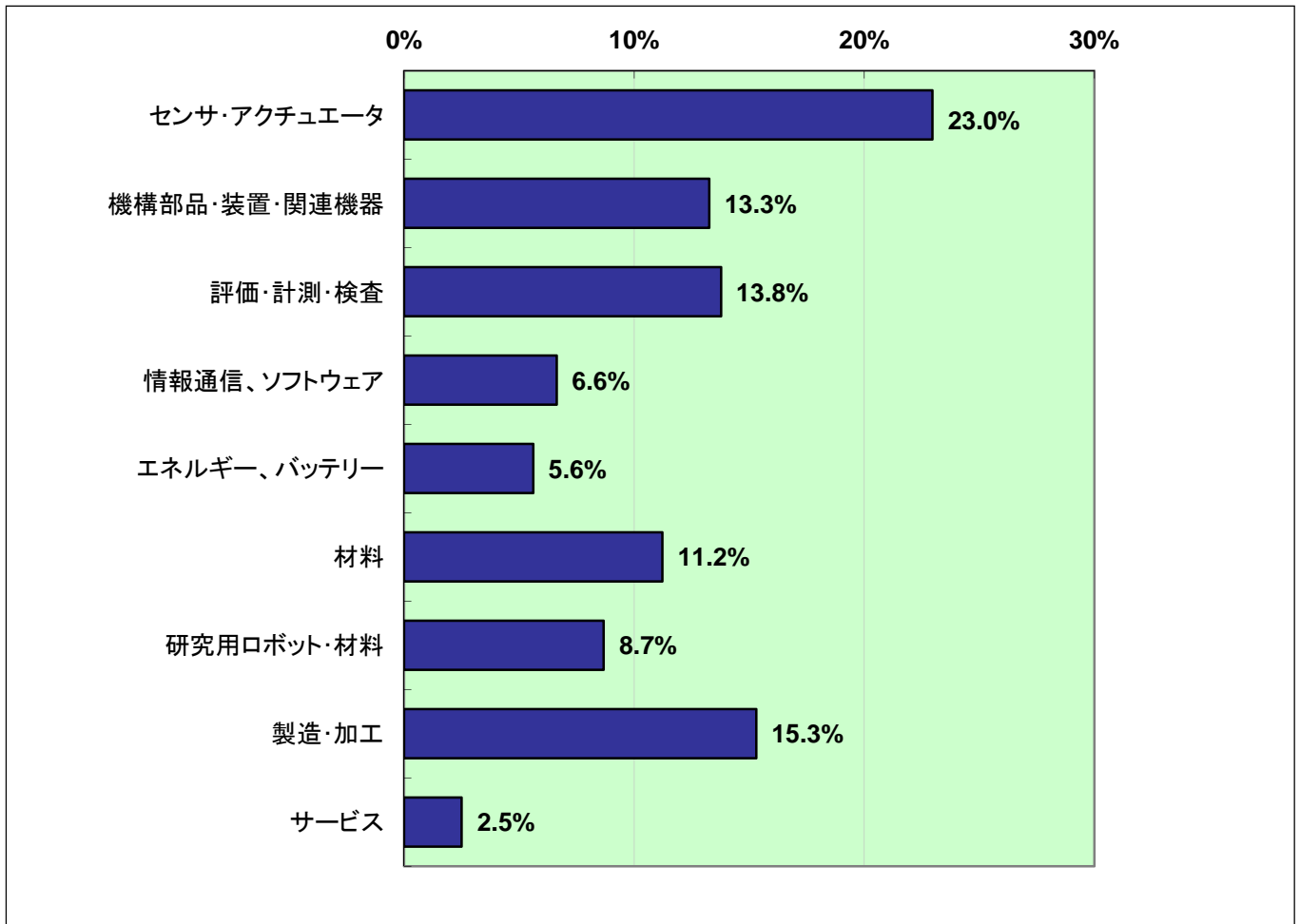
3. 来場動機



4. お探しの製品（複数回答） ナノ・マイクロ ビジネス展



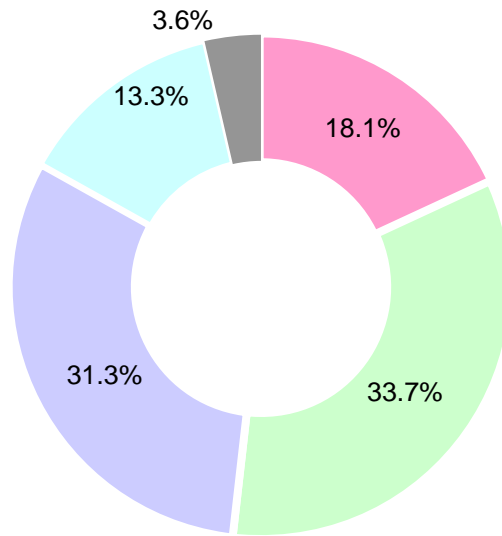
4. お探しの製品（複数回答）ROBOTECH



出展者アンケート結果

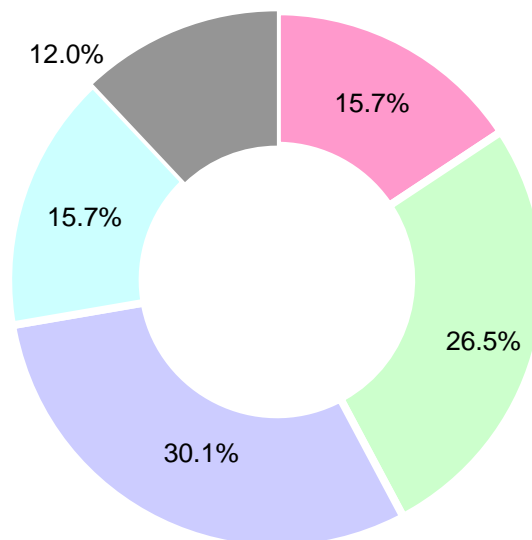
1.総合的な出展結果

満足	18.1%
やや満足	33.7%
普通	31.3%
やや不満足	13.3%
不満足	3.6%



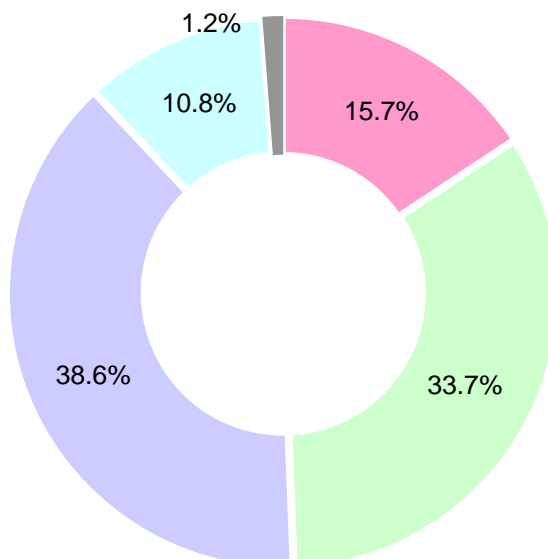
2.来場者数

満足	15.7%
やや満足	26.5%
普通	30.1%
やや不満足	15.7%
不満足	12.0%



3.来場者の質

満足	15.7%
やや満足	33.7%
普通	38.6%
やや不満足	10.8%
不満足	1.2%



出展者リスト

国内企業・団体

(／は共同出展者)(2015年4月9日現在)

ア アールエフ	A-7	カ かわさき・神奈川ロボットビジネス協議会	D-7	電子技研工業(株)	E-4
アクテス京三(株)	B-10	／認定NPO法人ロボティック普及促進センター		東邦化研(株)	C-7
アサヒ・テクノソリューションズ(株)	G-1	かわさきコアテクノロジー&ソリューションズ	D-11	(株)ニコンテック	C-12
(株)アシストナビ	C-4	／(株)イクシスリサーチ		日本フィルコン(株)	C-5
アダマンド(株)	B-1	／かながわサイエンスパーク(KSP)		(株)日本レーザー	B-7
／マイクラライン		／かわさき新産業創造センター(KBIC)		ハ パーク・システムズ・ジャパン(株)	D-1
／プレサイスリー マイクロテクノロジー		／(株)テクノロード		ファナック(株)	C-10
アルテック(株)	D-13	／プロソニック(株)		(株)フクダ	D-4
伊藤精工(株)	D-5	カンタムエレクトロニクス(株)	D-9	富士電機(株)	D-10
ウシオ電機(株)	C-14	(株)協同インターナショナル	D-15	(株)堀場エステック	B-3
(株)エーシングテクノロジーズ	D-14	／SILEX MICROSYSTEMS		(一財)マイクロマシンセンター	A-2 B-8
エーディーワイ(株)/MSG Lithoglas GmbH	A-8	(有)ケイ・エム技研	C-11	(一財)マイクロマシンセンターコアモニタリング研究体	A-1
(株)エス・イー・エイ	A-4	計測エンジニアリングシステム(株)	B-5	／国立研究開発法人新エネルギー・	
(株)SPIエンジニアリング	B-12	(株)コシブ精密	B-6	産業技術総合開発機構(NEDO)	
SPPテクノロジーズ(株)	C-8	(株)コスモサウンド	A-5	丸紅情報システムズ(株)	C-13
／SPTS Technologies Ltd.		サ SCIVAX(株)	D-3	(株)ミクロプ	D-8
(株)エヌ・ティー・エス	C-9	サカセ化学工業(株)	C-1	みずほ情報総研(株)	A-3
(株)NTTデータエンジニアリングシステムズ	B-4	サムコ(株)	C-2	(株)ミットヨ	D-12
技術研究組合NMEMS技術研究機構	B-0	ジェー・エー・ウーラム・ジャパン(株)	D-16	三菱重工業(株)	B-11
／国立研究開発法人新エネルギー・		(株)シリコンセンシングシステムズジャパン	C-6	／双日マシナリー(株)	
産業技術総合開発機構(NEDO)		タ 田口電機工業(株)	B-9	／(株)たけびし	
エム・アイ・エス テクノロジー(株)	C-15	(株)D-process	D-2	三菱電機(株)	A-6
オックスフォード・インストゥルメンツ(株)	B-2	DMカードジャパン(株)	D-6		

アカデミック パビリオン

科学研究費補助金 新学術領域「分子ロボティクス」	A-16	東京大学 IRT研究機構	A-9
金沢大学振動発電研究室	A-11	東京大学 実装工学分野研究室 日暮研究室	A-20
九州大学 ナノ・マイクロ医工学研究室	A-21	東京大学 先端科学技術研究センター 生田研究室	A-13
京都大学 田畑研究室 / 小寺研究室	A-19	東京大学 大学院 工学系研究科 バイオエンジニアリング専攻 鷺津研究室	A-25
首都大学東京 諸貴研究室	A-15	名古屋大学 新井研究室	A-22
(一社)電気学会 センサ・マイクロマシン部門(E部門)	E-23	立命館大学 先端マイクロ・ナノシステム技術研究センター	A-23
東京医科歯科大学 三林研究室	A-12	立命館大学 バイオメディカルデバイス研究センター	A-24
東京工業大学 大学院 理工学研究科 基礎物理学専攻 実吉研究室	A-14		
東京工業大学 メカノマイクロプロセス室	A-17		

オープンイノベーション

(地独)青森県産業技術センター	E-10	(一社)次世代センサ協議会	E-2
秋田県産業技術センター	E-11	富山県工業技術センター	E-19
地方(独)岩手県工業技術センター	E-7	新潟県工業技術総合研究所	E-18
(公財)神奈川科学技術アカデミー(KAST)	E-6	福島県ハイテクプラザ	E-9
神奈川県産業技術センター	E-21	(一財)マイクロマシンセンター MNOIC	E-3
京都大学ナノテクノロジーハブ拠点	E-17	宮城県産業技術総合センター	E-8
産業技術総合研究所 つくばイノベーションアリーナ推進センター	E-20	MEMS パークコンソーシアム	E-12
先端光加工プロジェクト(京都産学共同研究拠点「知恵の輪」)	E-1	文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム	E-14
／京都大学 大学院 工学研究科 材料化学専攻 機能材料設計学講座 三浦研究室		山形県工業技術センター	E-13
／京都大学 大学院 工学研究科 材料化学専攻 無機構造化学講座 平尾研究室		4大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアム	E-22
／次世代レーザープロセッシング技術研究組合			
／京都大学 産官学連携本部 日立造船寄付研究部門			
／(公財)京都高度技術研究所 新事業創出支援部SLグループ			

海外企業・団体

FISHELSON LTD.	E-5	VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND	G-2
FRAUNHOFER INSTITUTE FOR ELECTRONIC NANO SYSTEMS ENAS	A-0	／ADVACAM	

事務局コメント

この度は、ナノ・マイクロ ビジネス展/ROBOTECHにご出展を賜り、誠にありがとうございました。
出展各社様には、本年も新製品・サービス・情報を展示・発信していただき、来場者様からも高い満足の声をいただきました。ありがとうございました。

会期中にもご案内いたしました。弊社は本年の開催を以って本見本市のオーガナイザー業務を終了することとなります。

1990年に本見本市を立ち上げ、一般財団法人マイクロマシンセンター様主催としてご参画いただき、以降オーガナイザーとして計26回の長きにわたり本見本市を開催してまいりましたが、2015年度の開催をもって、本ナノ・マイクロビジネス展/ROBOTECHを大幅にリニューアルすることとなりました。

2016年以降は、一般財団法人マイクロマシンセンター様の事業の一環として、一般財団法人光産業技術振興協会様主催のInterOptoと同時期(10月)にMEMS センシング & ネットワークシステム展として開催することとなりました。企画・運営はInterOptoの企画推進業務を行っている株式会社ICS コンベンションデザイン様に引き継いでいただくこととなりましたことをご報告申し上げます。

26回という長年にわたり開催させていただきました本見本市の業務を終了することは弊社としても大変難しい決断となりました。これまでご出展・ご協力いただきました皆様にはこれまでのご厚情に感謝申し上げ、この度の決断によりご迷惑・ご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。

敬具

MEMS センシング & ネットワークシステム展のご案内

2016年10月5日(水)ー7日(金) パシフィコ横浜

主催: 一般財団法人マイクロマシンセンター

技術研究組合 NMEMS 技術研究所

(株)ICS コンベンションデザイン

お問合せ: (株)ICS コンベンションデザイン

Tel:03-3219-3643 Fax:03-3219-3628

E-mail:mems@ics-inc.co.jp

ナノ・マイクロ ビジネス展・ROBOTECH 事務局
メサゴ・メッセフランクフルト株式会社
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋 1-3-2 曙杉館 7F
Tel. 03-3262-8446 Fax. 03-3262-8442
E-mail:info@micromachine.jp
Web. www.micromachine.jp